

اللهُ أَكْبَرُ



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی  
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته  
شونده با زمان عملکرد زیر نانوثانیه با فشار کمتر از یک  
اتمسفر

نگارش: احسان هاشمی

اساتید راهنمای:  
دکتر کاوه نیایش، دکتر امیر عباس شایگانی اکمل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته: مهندسی برق - قدرت

شهریور ۱۳۸۷



دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق

## بررسی و شبیه سازی شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانوثانیه در فشار کمتر از اتمسفر

نگارش: احسان هاشمی

از این پایان نامه در تاریخ ۳۰/۰۶/۸۷ در مقابل هیأت داوران دفاع گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی: دکتر جواد فیض

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر: دکتر پرویز جبهه دار مارالانی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر: دکتر سعید نادر اصفهانی

اساتید راهنمای: دکتر کاوه نیایش، دکتر امیر عباس شایگانی اکمل

عضو هیأت داوران: دکتر حسین محسنی

عضو هیأت داوران: دکتر حسن منصف

عضو هیأت داوران: دکتر اصغر اکبری

### تعهدنامه احالت اثر

اینجانب، احسان هاشمی تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه، حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران، که در این نوشته از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع گردیده است. در ضمن، این پایان نامه قبلاً برای اهراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارایه نشده است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران می باشد.

احسان هاشمی

## قدردانی

در ابتدا بر خود لازم می بینم از پدر و مادر عزیزم که همواره مشوق و مایه دلگرمی من بوده اند یاد کرده و تقدیر به عمل آورم.

از اساتید راهنمای آقایان دکتر کاوه نیایش و کتر امیر عباس شایگانی اکمل به خاطر راهنمایی ها و مساعدت های بی دریغشان در جهت پیشبرد این پایان نامه قدردانی می کنم. همچنین بابت حمایت ها و همفکری های استاد گرامی دکتر حسین محسنی از ایشان کمال تشکر را به عمل می آورم.

در تکمیل این پایان نامه دوستانی چند مرا یاری نمودند که در اینجا بر خود لازم می بینم از این عزیزان قدر دانی نمایم. از آقایان مهندس ادریس عاقب و مهندس جواد کمیجانی به دلیل همیاری در به ثمر رساندن شبیه سازی شکست الکتریکی، آقای مهندس جویا جدیدیان به خاطر همکاری در بخش مدلسازی پلاسما و آقای مهندس سامان برزی به دلیل همیاریشان در پردازش و بهبود کیفیت تصاویر کمال تشکر را به عمل می آورم.

این پایان نامه حاصل همیاری همه این عزیزان با اینجانب می باشد.

احسان هاشمی

۱۳۸۷ شهریور

# مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر

نام و نام خانوادگی: احسان هاشمی  
شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۸۵۱۱۹

رشته تحصیلی و گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت - سیستم و فشار قوى  
دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر  
قطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  
تاریخ دفاع: ۱۳۸۷/۶/۳۰

اساتید راهنما: دکتر کاوه نیایش و دکتر امیر عباس شایگانی اکمل

## چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد:

کلید های بسته شونده دارای فاصله هوایی موسوم به اسپارک گپ<sup>۱</sup> کاربرد وسیعی در مهندسی فشار قوى و توان پالسی دارند. مبنای عملکرد این کلید ها مبتنی بر شکست الکتریکی می باشد. در این پایان نامه، هدف شبیه سازی شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه بوده است.

کلید هایی با زمان شکست بسیار کوتاه در سیستم های رادار با پهنهای باند بسیار بالا، محدود کننده های پلاسمای<sup>۲</sup> و سیستم های شکل دهنده پالس در مهندسی توان پالسی به کار می رود.

در فصل اول این پایان نامه مختصراً راجع به مهندسی توان پالسی و معرفی کلیات سیستم های تولید پالس بیان می گردد. در ادامه نقش و انواع کلید در مهندسی توان پالسی معرفی می شود. از میان این کلید ها، کلید های بسته شونده با عایق گازی که شامل دو الکترود در محیط گازی می باشند و برای رسیدن به زمان عملکرد بسیار کوتاه (کمتر از نانو ثانیه) استفاده می شوند مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم مکانیزم های فیزیکی حاکم بر شکست الکتریکی به طور مفصل بیان می شود و معادلات حل شده برای مدل سازی شکست الکتریکی معرفی می گردد.

در فصل سوم روش و نتایج شبیه سازی شکست الکتریکی به طور مژروح بیان شده و اثر پارامتر های مختلف در شکست الکتریکی بررسی می شود.

در فصل چهارم مختصراً راجع به معادلات توصیف کننده فیزیک پلاسمای گازی بحث می شود و در ادامه رفتار کanal پلاسمای ایجاد شده در اثر شکست الکتریکی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل پنجم شامل جمع بندی و بیان نکات مهم ذکر شده در فصول قبلی می باشد.

<sup>1</sup> Spark gap switches

<sup>2</sup> Plasma limiters



## فهرست مطالب

۱	۱.	۱. مقدمه ای بر انواع کلید های مرسوم در مهندسی توان پالسی.....
۱	۱.۱	۱.۱ مقدمه بر مهندسی توان پالسی.....
۲	۱.۲	۱.۲ خصوصیات تکنولوژی توان پالسی.....
۳	۱.۳	۱.۳. ۱.۳ کلیدهای معمول در سیستم های توان پالسی.....
۴	۱.۳.۱	۱.۳.۱.۱ کلیدهای گازی.....
۱۰	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۱ کلیدهای بسته شونده نیمه هادی.....
۱۱	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۲ کلیدهای مغناطیسی.....
۱۲	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۳ کلیدهای بازشونده نیمه هادی.....
۱۳	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۴ کلیدهای بازکننده پلاسمایی.....
۱۵	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۵ فیوزهای انفجاری.....
۱۶	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۶ مقایسه ساختارهای مختلف از نظر محدوده عملکرد.....
۱۹	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۷ توصیف مکانیزم های فیزیکی حاکم بر روند شکست الکتریکی.....
۲۰	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۸ تقویت میدان الکتریکی.....
۲۴	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۹ تابش میدانی و حرارتی-میدانی الکترون از طریق اعمال میدان الکتریکی.....
۳۸	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۱۰ تابش انفجاری الکترون.....
۴۵	۱.۳.۱.۱	۱.۳.۱.۱.۱۱ مکانیزم های افزایش تعداد الکترون و تلف در شکست گازی.....
۴۵	۱.۳.۱.۲	۱.۳.۱.۲ یونیزاسیون در اثر برخورد.....
۴۶	۱.۳.۱.۲	۱.۳.۱.۲.۱ مکانیزم های تلف در شکست گازی.....
۴۷	۱.۳.۱.۲	۱.۳.۱.۲.۲ باز ترکیب (دیونیزاسیون).....
۴۷	۱.۳.۱.۲	۱.۳.۱.۲.۳ چسبیدن الکترون.....
۴۷	۱.۳.۱.۲	۱.۳.۱.۲.۴ تلفات تحریک .....
۴۸	۱.۳.۱.۲	۱.۳.۱.۲.۵ مکانیزم های شکست.....
۴۸	۱.۳.۱.۳	۱.۳.۱.۳.۱ مکانیزم تاونزند.....
۵۲	۱.۳.۱.۳	۱.۳.۱.۳.۲ ۲.۳.۱.۲ گسترش ستون نور.....
۵۳	۱.۳.۱.۳	۱.۳.۱.۳.۳ مروی مختصر بر فعالیت های انجام شده در زمینه شکست الکتریکی در رژیم نانو ثانیه.....
۵۶	۱.۳.۱.۳	۱.۳.۱.۳.۴ شبهه سازی و حل معادلات توصیف کننده شکست الکتریکی.....
۶۰	۱.۳.۱.۳	۱.۳.۱.۳.۵ مرحله اول: پیاده سازی ساختار الکترود ها جهت شبهه سازی.....

۶۴	..... ۲.۳ مرحله دوم: محاسبه توزيع پتانسیل و میدان الکتریکی
۶۷	..... ۳.۳ مرحله سوم: محاسبه ضرایب یونیزاسیون
۶۸	..... ۴.۳ مرحله چهارم: حل معادلات یونیزاسیون
۶۹	..... ۵.۳ مرحله پنجم: محاسبه جریان بین الکترودها به منظور تعیین لحظه وقوع شکست الکتریکی
۷۰	..... ۶.۳ نتایج شبیه سازی
۷۴	..... ۷.۳ تعیین شرایط بهینه فشار بر اساس نتایج شبیه سازی
۸۱	..... ۸.۳ بررسی اثر خودگی الکترود ها در طی روند وقوع شکست الکتریکی
۸۳	..... ۹.۳ بررسی اثر تغییرات جزئی ابعاد الکترود در پارامتر های شکست الکتریکی
۸۵	..... ۴. بررسی رفتار کanal پلاسمای تشکیل شده در اثر وقوع شکست الکتریکی
۸۵	..... ۱.۴ مکانیزم های حاکم بر پلاسمای گازی
۸۶	..... ۲.۴ مدل سازی کanal پلاسمای تشکیل شده در اثر شکست الکتریکی
۹۲	..... ۵. نتیجه گیری
۹۴	..... مراجع
۹۸	..... ضمیمه: مقالات ارائه شده از پایان نامه



## فهرست جداول

۱	.....	<b>فصل اول</b>
۱	.....	جدول (۱.۱) : مقادیر معمول در مهندسی توان پالسی
۴	.....	جدول (۲.۱) : انواع کلیدها
۱۷	.....	جدول (۳.۱) : مقایسه عملکرد کلیدهای مختلف (بسته شونده)
۱۹	.....	<b>فصل دوم</b>
۲۳	.....	جدول (۱.۲) : مدار موثر $\beta$ و سطح ساطع کننده الکترون برای N برآمدگی
۲۵	.....	جدول (۲.۲) : تابع کار فلزات مختلف به کار رفته در سطح الکترود
۴۴	.....	جدول (۳.۲) : خصوصیات فلزات مختلف به کار رفته در ساختار الکترود
۵۰	.....	جدول (۴.۲) : توصیف پارامتر های مربوط به معادله (۳۳.۲)
۵۰	.....	جدول (۵.۲) : مقادیر به دست آمده برای ضریب A و B برای گازهای مختلف
۵۶	.....	<b>فصل سوم</b>
۷۶	.....	جدول (۱.۳) : اطلاعات شکست مربوط به پالس ولتاژ ۱۰۰۰ پیکو ثانیه
۷۶	.....	جدول (۲.۳) : اطلاعات شکست مربوط به پالس ولتاژ ۵۰۰ پیکو ثانیه
۸۱	.....	جدول (۳.۳) : مقادیر مربوط به متغیر حالت و حالت های ماده متناظر با آن
۸۴	.....	جدول (۴.۳) : بررسی اثر تغییر شعاع انحصار بر زمان شکست
۸۴	.....	جدول (۵.۳) : بررسی اثر تغییر فاصله الکترودها بر زمان شکست
۸۵	.....	<b>فصل چهارم</b>
۹۱	.....	جدول (۲.۴) : تغییرات اندوکتانس کانال پلاسما بر حسب زمان

## فهرست اشکال

۱	.....	<b>فصل اول</b>
۲	.....	شکل (۱.۱) : پارامترهای یک پالس.....
۳	.....	شکل (۲.۱) : بلوک دیاگرام یک سیستم تولید توان پالسی نمونه.....
۵	.....	شکل (۳.۱) : نمایی از کلید تریگاترون با ساختار های الکترود تریگر متفاوت.....
۶	.....	شکل (۴.۱) : دیاگرام مداری یک کلید سه الکترود.....
۷	.....	شکل (۴.۵) : نمایی از کلید ایگنیترون .....
۸	.....	شکل (۶.۱) : دو ساختار مختلف کلید ریل-گپ.....
۸	.....	شکل (۶.۷) : نمایی از کلید تخلیه سطحی.....
۹	.....	شکل (۸.۱) : شماتیک کلی کلید چند طبقه، نمونه ساخته شده برای ولتاژ ۶ مگاولت و مدار معادل این نوع کلید.....
۱۰	.....	شکل (۹.۱) : شماتیک کلی یک کلید سوادو-اسپارک گپ.....
۱۱	.....	شکل (۱۰.۱) : مقایسه محدوده عملکرد کلیدهای مختلف نیمه هادی.....
۱۱	.....	شکل (۱۱.۱) : نمایی از یک مدار با استفاده از کلید های مغناطیسی.....
۱۲	.....	شکل (۱۲.۱) : نمایی از یک مدار فشرده کننده پالس و شکل موجهای مربوط به هر طبقه.....
۱۳	.....	شکل (۱۳.۱) : نحوه عملکرد کلیدهای .....
۱۳	.....	شکل (۱۴.۱) : نمایی از ساختار کلید PEOS .....
۱۴	.....	شکل (۱۵.۱) : مراحل مختلف عملکرد کلید PEOS .....
۱۴	.....	شکل (۱۶.۱) : شماتیک ساختاری و عملکردی کلیدهایی با پلاسمای متحرک .....
۱۵	.....	شکل (۱۷.۱) : نمایی از ساختار یک نمونه فیوز انفجاری .....
۱۶	.....	شکل (۱۸.۱) : طبقه بندی کلیدهای مختلف از نظر مقیاس چگالی انرژی و انتقال حالت .....
۱۷	.....	شکل (۱۹.۱) : مقایسه محدوده عملکرد کلیدهای مختلف از دید ماکزیمم ولتاژ و جریان قابل تحمل .....
۱۹	.....	<b>فصل دوم</b>
۱۹	.....	شکل (۱.۲) : فلوچارت روند وقوع شکست الکتریکی در گاز.....
۲۰	.....	شکل (۲.۲) : افزایش شدت میدان الکتریکی بر روی ناهمواری های سطح الکترود.....

۲۱	شكل(۳.۲): مقدار $\beta$ برای ساختارهای مختلف برآمدگی های میکروسکوپی در سطح الکترود.....
۲۳	شكل(۴.۲): تغییرات ضریب موثر $\beta$ و سطح موثر تابش الکترون بر حسب تغییرات میدان الکتریکی اعمالی.....
۲۶	شكل(۵.۲): تغییرات چگال جریان تزریقی از الکترود بر حسب تغییرات $\beta$ .....
۲۶	شكل(۶.۲): ابر کروی الکترون تشکیل شده در نوک برآمدگی موجود بر روی کاتد.....
۲۸	شكل(۷.۲): تغییرات چگالی الکترون تزریق شده از الکترود بر حسب تغییران ضریب $\beta$ .....
۲۹	شكل(۸.۲): تغییرات میدان الکتریکی بار ر فضایی در مقایسه با میدان الکتریکی خارجی بر حسب تغییرات شعاع حجم حاوی بار الکتریکی.....
۳۰	شكل(۹.۲): میدان الکتریکی بارهای فضایی بر حسب ضریب $\beta$ در مقایسه میدان اعمالی برای شعاع های مختلف حجم بار فضایی.....
۳۲	شكل(۱۰.۲): گذرای خاموش شدن و روشن شدن تابش الکترون از سطح الکترود.....
۳۳	شكل(۱۱.۲): نوسانات میدان الکتریکی در برآمدگی الکترود.....
۳۳	شكل(۱۲.۲): تعادل بین میدان الکتریکی ناشی از بارهای فضایی و میدان تقویت شده نوک برآمدگی موجود در سطح الکترود .....
۳۶	شكل(۱۳.۲): انرژی پتانسیل یک الکترون در نزدیکی سطح فلز.....
۳۹	شكل(۱۴.۲): تبخیر و انفجار برجستگی های روی الکترود.....
۴۰	شكل(۱۵.۲): رفتار جریان در روند وقوع تابش انفجاری الکترون.....
۴۳	شكل(۱۶.۲): زمان تاخیر وقوع تابش انفجاری الکترون برای تنگستان بر حسب.....
۴۴	شكل(۱۷.۲): تغییرات زمان تاخیر برای تابش انفجاری الکترون بر حسب ضریب تقویت میدان الکتریکی برای فلزات مختلف.....
۴۹	شكل(۱۸.۲): نمودار تغییرات جریان بر حسب ولتاژ اعمالی.....
۵۱	شكل(۱۹.۲): ساختار بهمن الکترونی.....
۵۳	شكل(۲۰.۲): روند پیشرفت ستون نوری.....

۵۶	<b>فصل سوم.....</b>
۵۷	شكل(۱.۳): قسمتی از شبکه شامل نقطه ۰ و چهار نقطه اطراف آن.....
۵۹	شكل(۲.۳): فلوچارت روند حل معادلات توصیف کننده شکست الکتریکی.....
۶۲	شكل(۳.۳): ساختار الکترودهای در نظر گرفته شده به منظور شبیه سازی.....
۶۳	شكل(۴.۳): شکل موج ولتاژ اعمالی به الکترود ها.....

.....	<b>شكل (۵.۳): توزیع پتانسیل و شدت میدان الکتریکی به ازای ولتاژ نهایی.</b>
.....	<b>شكل (۶.۳): توزیع شدت میدان الکتریکی به ازای ولتاژ نهایی.</b>
.....	<b>شكل (۷.۳): توزیع چگالی الکترون در زمان های مختلف در طی فرآیند شکست.</b>
.....	<b>شكل (۸.۳): توزیع چگالی الکترون در زمان های مختلف در طی فرآیند شکست.</b>
.....	<b>شكل (۹.۳): توزیع چگالی الکترون برای ساختار های صفحه-صفحة و سوزن- سوزن در پله های زمانی مختلف.</b>
.....	<b>شكل (۱۰.۳): تغییر زمان شکست بر حسب فشار به ازای دو پیک ولتاژ مختلف.</b>
.....	<b>شكل (۱۱.۳): تغییر زمان شکست بر حسب فشار به ازای دو زمان صعود مختلف.</b>
.....	<b>شكل (۱۲.۳): نمودار تابع هدف برای پالس ولتاژ ۱۰۰۰ پیکو ثانیه.</b>
.....	<b>شكل (۱۳.۳): نمودار تابع هدف برای پالس ولتاژ ۵۰۰ پیکو ثانیه.</b>
.....	<b>شكل (۱۴.۳): زمان شکست برای هوا بر حسب فشار به ازای سه فاصله الکترود متفاوت.</b>
.....	<b>شكل (۱۵.۳): زمان شکست برای آرگون بر حسب فشار به ازای سه فاصله الکترود.</b>
.....	<b>شكل (۱۶.۳): ولتاژ شکست برای هوا بر حسب فشار به ازای سه فاصله الکترود.</b>
.....	<b>شكل (۱۷.۳): ولتاژ شکست برای آرگون بر حسب فشار به ازای سه فاصله الکترود.</b>
.....	<b>شكل (۱۸.۳): ولتاژ شکست برای آرگون و هوا بر حسب فشار به ازای فاصله الکترود ۲ میلیمتر.</b>
.....	<b>شكل (۱۹.۳): ولتاژ شکست برای آرگون و هوا بر حسب فشار به ازای فاصله الکترود ۲ میلیمتر.</b>
.....	<b>شكل (۲۰.۳): توزیع دما در نقاط مختلف فضا.</b>
.....	<b>شكل (۲۱.۳): متغیر حالت در نقاط مختلف فضا.</b>
.....	<b>فصل چهارم</b>
.....	<b>شكل (۱.۴): توزیع سرعت الکترون ها در لحظات.</b>
.....	<b>شكل (۲.۴): توزیع چگالی شاز مغناطیسی در لحظات.</b>

# ۱. مقدمه ای بر انواع کلید های مرسوم در مهندسی توان پالسی

## ۱.۱ مقدمه بر مهندسی توان پالسی

مهندسی توان پالسی<sup>۱</sup> علم تولید و به کارگیری پالس های ولتاژ و جریان با مشخصات زمانی به خصوص و با دامنه های متفاوت می باشد. پالس های ولتاژی و جریانی با مشخصات مختلف هر کدام دارای کاربرد های به خصوصی در شاخه های متفاوت علوم می باشند. این کاربرد ها شامل کاربردهای نظامی، پزشکی، شیمیایی و حتی کاربرد در صنایع سنگین می باشد. تکنولوژی تولید پالسهایی با توان بالا یعنی<sup>۲</sup> HPPT، اولین بار در دهه ۶۰ در آمریکا و شوروی سابق مطرح گردید. حدود رایج کمیت ها در این علم در جدول زیر آمده است.

۱۰ <sup>-۷</sup> ژول	انرژی
۱۰ <sup>-۱۴</sup> وات	توان
۱۰ <sup>-۷</sup> ولت	ولتاژ
۱۰ <sup>-۳</sup> -۱۰ <sup>-۷</sup> آمپر	جریان
۱۰ <sup>-۶</sup> -۱۰ <sup>-۱۱</sup> آمپر بر مترمربع	چگالی جریان
۱۰ <sup>-۵</sup> -۱۰ <sup>-۱</sup> ثانیه	طول پالس

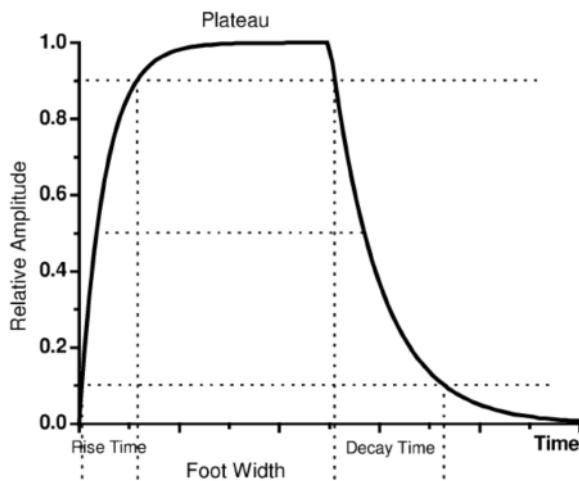
جدول(۱.۱) : مقادیر معمول در مهندسی توان پالسی

افزایش تقاضا نسبت به مولدهایی با توان بالا و نیز انتقال اینگونه توانها به بار<sup>۳</sup> منجر به توسعه و گسترش روزافزون تکنولوژی توان پالسی گردیده است. همانطور که از جدول بالا بر می آید، علاوه بر انرژی و توان پالس، شکل پالس اعم از زمان صعود و زمان نزول و نیز زمانی که می باشد پالس در ماکریم خود ثابت باقی بماند نیز دارای اهمیت می باشد. شکل کلی یک پالس و زمانهای ذکر شده در شکل (۱.۱) به نمایش در آمده است.

<sup>۱</sup> Pulsed power engineering

<sup>۲</sup> High Pulsed Power Technology

<sup>۳</sup> Load



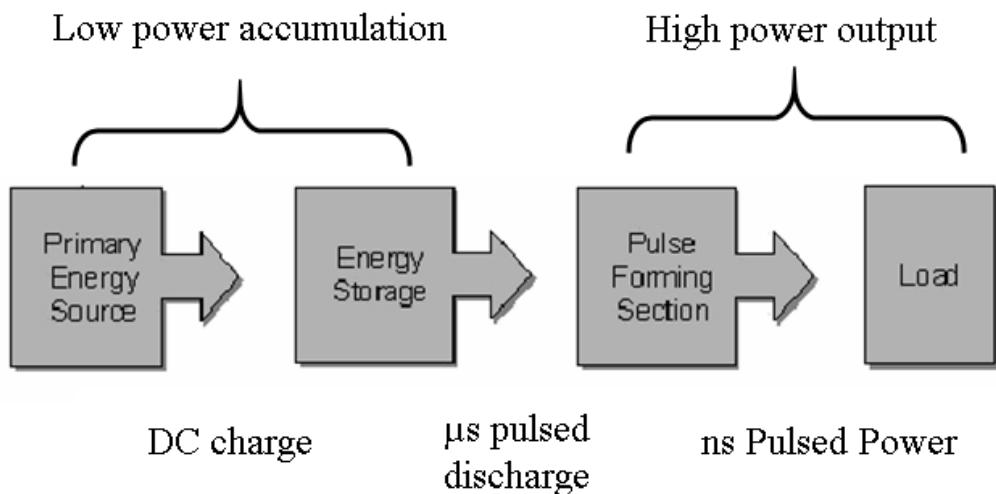
شکل(۱.۱) : پارامترهای یک پالس

## ۲.۱ خصوصیات تکنولوژی توان پالسی [۱]

توانهای الکتریکی معمول که در شبکه های الکتریکی امروزی منتقل می گردد، مداوم و در سطح بسیار پایینی می باشند و انرژی الکتریکی، پیوسته و بتدربیج به بارها منتقل می گردد. مثلا برای بارهای خانگی معمول، انرژی نسبتا زیادی برای این بارها ارسال گردد، اما چون این مقدار انرژی در زمان طولانی منتقل شده است، نیازی به تامین توان زیادی برای این بارها نمی باشد. در تکنولوژی HPPT، نیاز به محدوده وسیعی از انرژی است و چون در زمان بسیار کوچکی نیاز به این سطح انرژی می باشد، توانهای بسیار بالایی (تا حدود چند ترا وات<sup>۴</sup>) نیاز می باشد. از دید عملی، این تکنولوژی نیازمند تجهیزات بسیار پیچیده و تکنولوژیهای خاص می باشد. با این وجود، اصولی که این علم بر آن استوار شده است، نسبتا ساده می باشد. ایده اصلی این تکنولوژی، نگه داشتن انرژی در یک منبع انرژی اولیه در سطح توان و چگالی توان پایین به صورت موقت می باشد. سپس انرژی بسرعت از منبع ذخیره آزاد گردیده و به شکل توان پالسی در می آید. بعد از فشرده سازی مجدد توان در یک شکل دهنده پالس<sup>۵</sup>، این توان در سطح بالا و با چگالی زیاد به بار منتقل می گردد. شکل (۲.۱)، ساختار کلی و اساس عملکرد یک سیستم نمونه تولید توان پالسی را نمایش می دهد.

<sup>4</sup> Tera Watt

<sup>5</sup> Pulse forming system



شکل (۲.۱) : بلوك دياگرام يك سيسنتم توليد توان پالسي نمونه [۲]

همانطور که در شکل نیز مشاهده می گردد، در وله اول نیاز به یک منبع ذخیره انرژی مناسب می باشد. ذخیره انرژی می تواند به طرق مختلف انجام گردد. برای مثال می توان انرژی را در فنرها به صورت مکانیکی، در گازهای فشرده، در باتریهای الکتروشیمیایی، در میدان الکتریکی و یا میدان مغناطیسی و ... ذخیره نمود. از میان روش‌های مذکور، ذخیره انرژی الکتریکی در خازنهای ذخیره انرژی مغناطیسی در سلفها از استقبال بیشتری برخوردار گردیده است.

میزان تقویت توان به کمک ساختار شماتیکی که در شکل (۲.۱) نشان داده شده است، می توان تا ۱۰ میلیون بار نسبت به سطح توان اولیه باشد. در آخرین طبقه مولد نیز انرژی و یا توان به صورت الکترومغناطیسی می باشد و در نهایت و بسته به نوع بار، می تواند به یکی از انواع مختلف تبدیل گردد.

یکی از بخش های مهم سیستم های تولید توان پالسی سیستم شکل دهنده پالس می باشد. این بخش از سیستم وظیفه تغییر شکل پالس مورد نظر را متناسب با کاربرد مورد نظر به عهده دارد. از جمله ادوات مهم به کار رفته در این بخش از سیستم کلید ها می باشند که به خصوص نقش تعیین کننده ای در مشخصات زمانی پالس خروجی دارند.

در این بخش انواع کلید های به کار رفته در سیستم های توان پالسی را به طور مختصر مورد بررسی قرار داده و در فصول آینده به طور خاص به کلید های بسته شونده گازی پرداخته خواهد شد.

### ۳.۱ کلیدهای معمول در سیستم های توان پالسی

در کاربردهای توان پالسی، اغلب نیاز به کلیدهایی می باشد که بتوانند در محدوده توانهای تا چندین تراوات عمل کنند. زمان صعود، شکل و دامنه پالس خروجی مولد به شدت وابسته به نحوه

عملکرد کلیدهای مورد استفاده می باشد، لذا اینگونه کلیدها می بایست خصوصیات ویژه ای داشته باشند که برخی از آنها عبارتند از:

- تحمل ولتاژهای بسیار بالا قبیل از بسته شده و هدایت
- عملکرد فوری بعد از تریگر شدن و انتقال بسیار سریع از وضعیت عایق کامل قبل از تریگر شدن به رسانای خوب بعد از عملکرد ( در مورد کلیدهای بسته شونده )
- قابلیت بازیابی بسیار سریع از وضعیت رسانایی به حالت عایق کامل و تحمل ولتاژ بعد از باز شدن
- زمان جیتر<sup>۶</sup> بسیار کم برای عملکرد در حد نانوثانیه

با توجه به خصوصیات مذکور، کلیدهای معمول در صنعت برق و یا هرگونه کلیدی که عملکرد مکانیکی دارد، قابلیت استفاده در این تکنولوژی را دارا نمی باشد. بر اساس تکنیکی که برای انتقال انرژی استفاده می شود، می توان کلیدهای مورد استفاده را به دو دسته کلی تقسیم نمود: کلیدهای باز شونده و بسته شونده. کلیدهای باز شونده برای سیستمهای ذخیره راکتیو استفاده می گردد و از نوع بسته شونده در سیستم های ذخیره خازنی بهره گرفته می شود. برخی از انواع کلی این دو نوع کلید را می توان در جدول (۲.۱) مشاهده نمود.

کلیدهای باز شونده	کلیدهای بسته شونده
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ کلیدهای بازشونده نیمه هادی<sup>۷</sup></li> <li>➢ (SOS)</li> <li>➢ کلیدهای بازکننده پلاسمایی</li> <li>➢ فیوزهای انفجاری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ کلیدهای گازی</li> <li>➢ کلیدهای بسته شونده نیمه هادی</li> <li>➢ کلیدهای مغناطیسی</li> </ul>

جدول (۲.۱): انواع کلیدها

### ۱۰.۳.۱ کلیدهای گازی [۲]

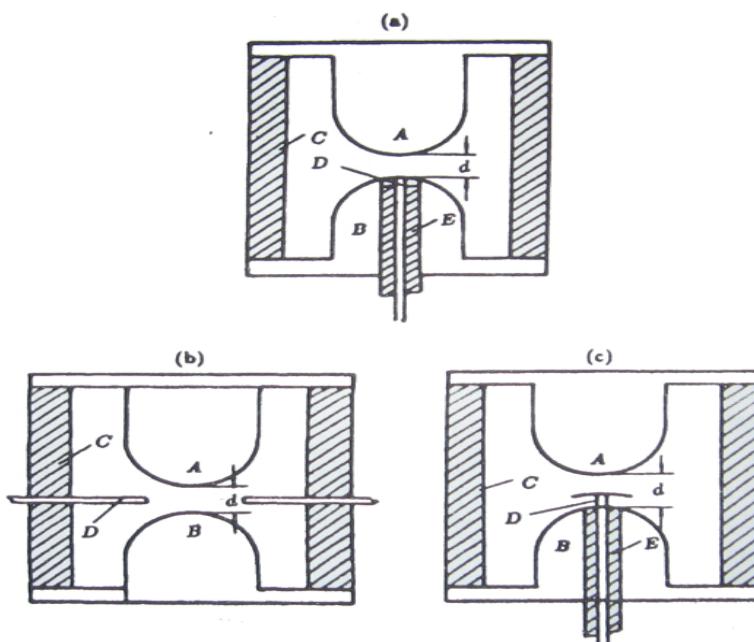
تقریبا همه انواع کلیدهای گازی بر اساس پدیده یونیزاسیون و شکست در گازها عمل می نمایند. گازها در حالت معمول به صورت عایق عمل می نمایند و در صورت ایجاد یونیزاسیون مانند هادی عمل می کنند. توانایی گازها را در هدایت جریان، میزان یونیزاسیون ایجاد شده تعیین می نماید. گازی که به شدت یونیزه شده باشد می تواند مانند هادی عمل نماید. در تکنولوژی کلیدها استفاده از یک منبع خارجی برای تزریق الکترونهای اولیه در گاز برای تسريع عمل یونیزاسیون معمول می باشد.

<sup>6</sup> Jitter time

<sup>7</sup> Semiconductor Opening Switches

این منبع خارجی می تواند به صورت اعمال ولتاژ بین الکتروود تریگر و کاتد و ایجاد یک جرقه اولیه و یا تابانیدن پرتو های پرانرژی مانند لیزر و یا اشعه های نورانی به گاز باشد.

کلیدهای گازی از نظر ساخت و نحوه عملکرد ساده می باشند و نیز محدوده عملکرد وسیعی دارند. این نوع کلیدها قابلیت هدایت جریان از چند آمپر تا چندین مگا آمپر و نیز تحمل ولتاژ تا چند مگاولت را دارا می باشند. اکثر این نوع کلیدها به صورت سه الکتروود ساخته می شوند که دو عدد آن، الکترودهای اصلی جهت هدایت جریان و الکتروود سوم برای تریگر نمودن استفاده می گردد. شکل (۳.۱) نمونه از این نوع ساختار را نشان می دهد که به تریگاترون<sup>۸</sup> موسوم است.



شکل (۳.۱) : نمایی از کلید تریگاترون با ساختار های الکتروود تریگر متفاوت . A و B الکتروود های اصلی، C ساختار عایقی و نگدارنده، D الکتروود تریگر و E ساختار عایقی جدا کننده الکتروود تریگر از الکتروود اصلی می باشند.[۳]

از مزایای تریگاترون عبارتند از:

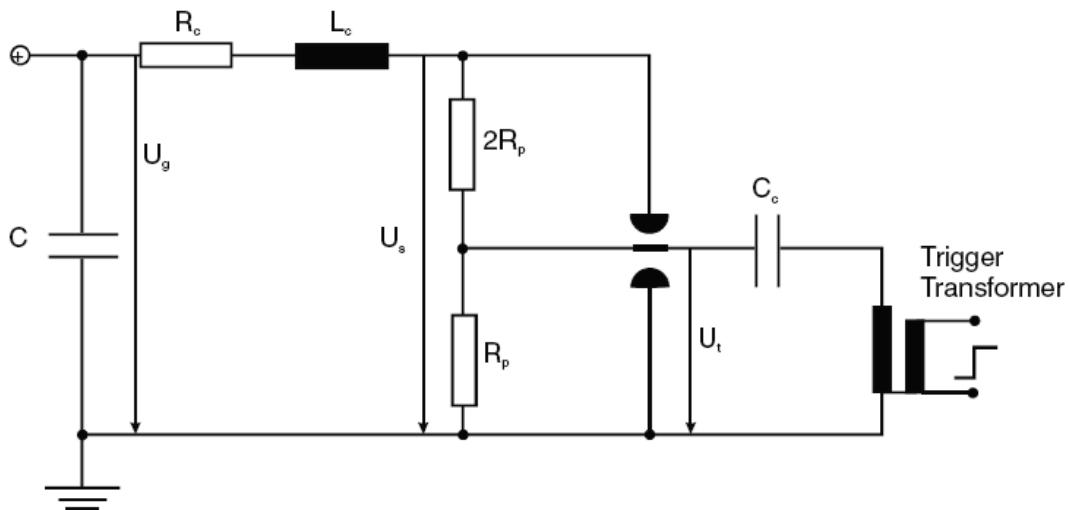
- محدوده گسترده تریگر کردن: فاصله هوایی اصلی با حدود ۲۵ درصد ولتاژ اعمالی به کلید می تواند تریگر شود که در این ولتاژ کم، تاخیر و جیتر بسیار کم می شود.
- توانایی تریگر شدن مناسب: این نوع کلید تاخیر و جیتر نسبتاً کوچکی تولید می نماید. برای فاصله هوایی برای تحمل ولتاژ ۱۰۰ کیلوولت، تاخیر در حدود ۲۰ تا ۳۰ نانوثانیه با جیتر کمتر از ۵ نانوثانیه را می توان تولید نمود.
- ساختار ساده: این نوع ساختار بسیار ساده تری نسبت به باقی ساختارها دارد.

برخی از معایب و ضعف های این نوع کلیدها عبارتند از:

<sup>8</sup> Trigatron

- نیاز به منبعی برای تریگر: این کلید نیاز به منبعی با توانایی کافی دارد تا بتواند ولتاژی با زمان صعود بسیار کم و دامنه قابل مقایسه با ولتاژ اعمالی به الکترودهای اصلی ایجاد نماید که به جریان قابل ملاحظه ای نیاز دارد.
- ایزولاسیون الکتریکی مدار تریگر: در هنگام وصل کلید، الکترود تریگر به ولتاژ آند متصل می گردد. بنابراین نیاز به اضافه کردن المانی مانند مقاومت سری با مدار تریگر وجود دارد که البته اینگونه المانها بر عملکرد کلید تاثیر می گذارند.
- خوردگی الکترود تریگر: در کاربردهای جریان بالا، ممکن است خوردگی الکترود تریگر، مکانیزم تریگر را تحت تاثیر قرار دهد.

در شکل (۴.۱)، نمونه‌ای از مدار فرمان و اعمال پالس جهت تریگر نمودن کلید نمایش داده شده است.



شکل (۴.۱) : دیاگرام مداری یک کلید سه الکترود

یکی دیگر از کلیدهای گازی که در گذشته کاربرد وسیعی داشته است، ایگنیترون<sup>۹</sup> می باشد. در این نوع کلید، از جیوه به عنوان ماده تریگر کننده استفاده می شود. همانطور که می دانیم کشش سطحی مابین جیوه و فلزات دیگر بسیار کم می باشد و به همین دلیل در سطح تماس آنها اتصال خوبی برقرار نمی گردد و در نتیجه این تماس مقاومت بالایی دارد. وقتی الکترود ایگنیتر<sup>۱۰</sup> را در جیوه قرار می دهند و به آن پالسی اعمال می گردد، به خاطر تلفات و گرمای بالای ایجاد شده در سطح تماس، جیوه بخار می گردد و در گاز پخش می گردد. برای جلوگیری از پاشیده شدن جیوه برروی آند، صفحه ای برروی آن قرار می دهند که به نام بافل<sup>۱۱</sup> شناخته می شود. نمایی از این نوع کلید در شکل (۵.۱) نشان داده شده است.

<sup>۹</sup> Ignitron

<sup>۱۰</sup> Igniter

<sup>۱۱</sup> Baffle